学 位 論 文 公 聴 会

日 時 ： 2月 19日（木） 午前 ~~午後~~ 10時00分 ～ 11時30分

場 所 ： 桂キャンパス Aクラスター2棟 第302室

講演者 ： 工学研究科材料化学専攻

若松 岳

論文題目 ：
Study on Preparation, Characterization and Device Application of α-Ga_2O_3 Thin Film

（α-Ga_2O_3薄膜の作製，特性評価，デバイス応用に関する研究）